

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

BEST AVAILABLE COPY

012841879 **Image available**

WPI Acc No: 2000-013711/200001

XRPX Acc No: N00-010585

Optical modulation interferometric measuring device for surface shape, roughness or spacing

Patent Assignee: BOSCH GMBH ROBERT (BOSC)

Inventor: DRABAREK P; DUVOISIN M; MARCHAL D; THOMINET V

Number of Countries: 020 Number of Patents: 007

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
WO 9957506	A1	19991111	WO 99DE1242	A	19990427	200001 B
DE 19819762	A1	19991125	DE 1019762	A	19980504	200002
EP 1082580	A1	20010314	EP 99929030	A	19990427	200116
			WO 99DE1242	A	19990427	
JP 2002513919	W	20020514	WO 99DE1242	A	19990427	200236
			JP 2000547424	A	19990427	
US 6490046	B1	20021203	WO 99DE1242	A	19990427	200301
			US 2001674785	A	20010205	
EP 1082580	B1	20030402	EP 99929030	A	19990427	200325
			WO 99DE1242	A	19990427	
DE 59904854	G	20030508	DE 504854	A	19990427	200332
			EP 99929030	A	19990427	
			WO 99DE1242	A	19990427	

Priority Applications (No Type Date): DE 1019762 A 19980504

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

WO 9957506 A1 G 26 G01B-009/02

Designated States (National): JP US

Designated States (Regional): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU

MC NL PT SE

DE 19819762 A1 G01B-009/02

EP 1082580 A1 G G01B-009/02 Based on patent WO 9957506

Designated States (Regional): DE FR GB NL

JP 2002513919 W 21 G01B-009/02 Based on patent WO 9957506

US 6490046 B1 G01B-009/02 Based on patent WO 9957506

EP 1082580 B1 G G01B-009/02 Based on patent WO 9957506

Designated States (Regional): DE FR GB NL

DE 59904854 G G01B-009/02 Based on patent EP 1082580

Based on patent WO 9957506

Abstract (Basic): WO 9957506 A1

NOVELTY - The measuring device has an interferometer (1) providing 2 partial beams delayed relative to one another by a modulation device (14,14') and a measuring probe (2) associated with the interferometer, having a solid block (26,27,27') for providing a measuring beam and a reference beam providing an interference pattern at the surface, evaluated via a reception unit (3). The measuring probe is separate from the interferometer and coupled to it via an optical waveguide (4).

USE - The measuring device is used for determining the shape roughness, or spacing of surfaces.

ADVANTAGE - The device is simple and compact for easy use.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a schematic

representation of an interferometric measuring device.

Interferometer (1)

Measuring probe (2)

Reception unit (3)

Optical waveguide (4)

Modulation device (14, 14')

Solid block (26, 27, 27')

pp; 26 DwgNo 2/3

Title Terms: OPTICAL; MODULATE; INTERFEROMETER; MEASURE; DEVICE; SURFACE;
SHAPE; ROUGH; SPACE

Derwent Class: S02; V07

International Patent Class (Main): G01B-009/02

International Patent Class (Additional): G01B-011/00; G01J-009/04;
G01N-021/45

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): S02-A03A; S02-A03B2; S02-A03B3; S02-A03B5; V07-N01

?



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 Offenlegungsschrift
10 DE 198 19 762 A 1

21 Aktenzeichen: 198 19 762.4
22 Anmeldetag: 4. 5. 98
43 Offenlegungstag: 25. 11. 99

51 Int. Cl.⁶:
G 01 B 9/02
G 01 B 11/00
G 01 J 9/04
G 01 N 21/45
// G 01 B 11/30, G 02 B 27/48

DE 198 19 762 A 1

71 Anmelder:
Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE
74 Vertreter:
Jeck . Fleck . Herrmann Patentanwälte, 71665
Vaihingen

72 Erfinder:
Drabarek, Pawel, Dr., 75233 Tiefenbronn, DE;
Duvoisin, Marc-Henri, Prévèrenge, CH; Marchal,
Dominique, Vallorbe, CH; Thominet, Vincent,
Echandens, CH

56 Entgegenhaltungen:

DE 1 95 20 305 C2
DE 43 36 318 A1
DE 41 08 944 A1
DE 39 06 118 A1
EP 01 26 475 B1

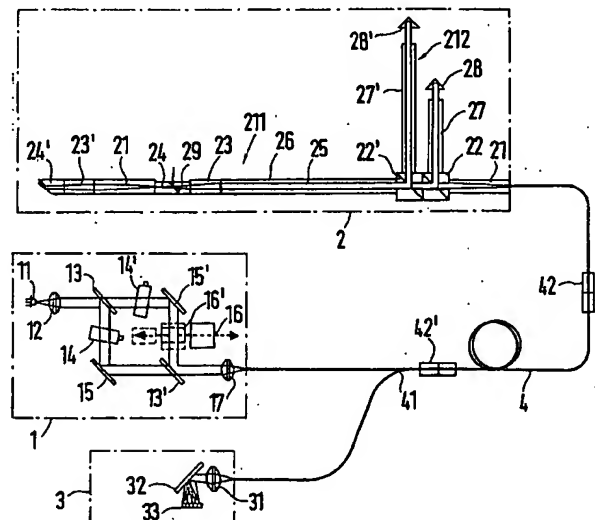
DE-Z: ULRICH, R., KOCH, A.: Faseroptischer
Antastensor für raue Oberflächen, in: Fein-
werktechnik und Meßtechnik F & M, 100 (1992) 11,
S.521-524;

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

54 Interferometrische Meßeinrichtung

57 Die Erfindung bezieht sich auf eine interferometrische Meßeinrichtung zum Erfassen der Form, der Rauheit oder des Abstandes von Oberflächen. Die interferometrische Meßeinrichtung weist ein Modulationsinterferometer (1) auf, in dem zwei Teilstrahlen gebildet werden, von denen der eine gegenüber dem anderen mittels einer Modulationseinrichtung (14, 14') in seiner Licht-Phase oder Licht-Frequenz verschoben ist. Mit einer an das Modulationsinterferometer (1) angeschlossenen Meßsonde (2), in der ein Meßstrahl und ein Referenzstrahl gebildet werden, wird die Oberfläche vermessen und aus dem Meßstrahl und dem Referenzstrahl ein Interferenzmuster gebildet, das in einer angeschlossenen Empfängereinheit (3) ausgewertet wird. Ein kompakter, auch in einem Fertigungsprozeß leicht zu handhabender Aufbau wird dadurch erzielt, daß das als Baueinheit aufgebaute Modulationsinterferometer (1) von der Meßsonde (2) räumlich getrennt und über eine Lichtleitfaseranordnung (4) mit dieser koppelbar ist und daß der Meßzweig (211) und der Referenzzweig (212) durch den Meßstrahl und den Referenzstrahl leitende Festkörper gebildet sind (Fig. 2).



DE 198 19 762 A 1

Die Erfindung bezieht sich auf eine interferometrische Meßeinrichtung zum Erfassen der Form, der Rauheit oder des Abstandes von Oberflächen mit einem Modulationsinterferometer, das eine räumlich kohärente Strahlungsquelle und einen ersten Strahlteiler zum Aufteilen von deren Strahlung in zwei Teilstrahlen aufweist, von denen der eine gegenüber dem anderen mittels einer Modulationseinrichtung in seiner Licht-Phase oder Licht-Frequenz gegenüber dem anderen verschoben ist und anschließend die beiden Teilstrahlen vereinigt sind, mit einer Meßsonde, in der die vereinigten Teilstrahlen in einen durch einen Meßzweig geführten und an der Oberfläche reflektierten Meßstrahl sowie einen durch einen Referenzzweig geführten und darin reflektierten Referenzstrahl aufgeteilt werden und in der der reflektierte Meßstrahl mit dem reflektierten Referenzstrahl überlagert wird, und mit einer Empfängereinheit zum Aufspalten der überlagerten Strahlung in mindestens zwei Strahlen mit unterschiedlichen Wellenlängen und Umwandeln der Strahlung in elektrische Signale und zum Auswerten der Signale auf der Grundlage einer Phasendifferenz.

Eine derartige interferometrische Meßeinrichtung ist in der EP 0 126 475 B1 als bekannt ausgewiesen. Bei dieser bekannten Meßeinrichtung werden raue Oberflächen eines Meßobjektes interferometrisch ausgemessen, wobei eine Strahlerzeugungseinheit mit Laserlichtquellen verwendet wird, die Licht unterschiedlicher Wellenlängen abgeben. Mittels eines Strahlteilers wird das Laserlicht in einen Referenzstrahl eines Referenzstrahlenganges und einen Meßstrahl eines Meßstrahlenganges aufgeteilt. Der Meßstrahlengang trifft auf die zu vermessende Oberfläche, während der Referenzstrahlengang an einer Referenzfläche z. B. in Form eines Spiegels reflektiert wird. Das von der Oberfläche und der Referenzfläche reflektierte Licht wird im Strahlteiler vereinigt und mit Hilfe einer Linse in eine Interferogrammebene fokussiert, in der ein Speckle-Muster auftritt. Dieses Speckle-Muster wird zur Bestimmung der Oberflächenform ausgewertet, wobei eine Phasendifferenz der Interferogramphasen im Meßpunkt bestimmt wird. Zur Vereinfachung der Auswertung wird ein Heterodyn-Verfahren angewendet, wobei die Frequenz des Referenzstrahles um eine Heterodyn-Frequenz mittels einer Frequenzverschiebungseinrichtung im Referenzstrahlengang gegenüber der Frequenz des Meßstrahles verschoben wird. Mit dieser Meßeinrichtung können Oberflächenformen fein aufgelöst werden. Jedoch sind die Justierung und Handhabung beispielsweise für einen Einsatz in der industriellen Fertigung aufwendig.

Eine weitere interferometrische Meßeinrichtung ist in der DE 39 06 118 A1 angegeben, bei der zwischen mehreren Laserlichtquellen und einem Meßabschnitt Lichtleitfasern vorgesehen sind. Auch hierbei wird zum Bestimmen der Oberflächenstrukturen eine Phasendifferenz ausgewertet. Hinsichtlich der Handhabung und Justierung an schwer zugänglichen Stellen ist auch dieser bekannte Aufbau ungünstig.

Wesentlich günstiger für den praktischen Einsatz beispielsweise in einem Fertigungsprozeß ist eine in der nicht vorveröffentlichten deutschen Patentanmeldung 198 08 273.8 angegebene weitere interferometrische Meßeinrichtung, die ein Modulationsinterferometer und eine davon räumlich getrennte, mittels einer Lichtleitfaseranordnung angekoppelte Meßsonde aufweist. Günstig sind hierbei insbesondere eine zeitlich kurzkohärente Strahlungsquelle des Modulationsinterferometers, wodurch eine stabile, gut auswertbare Strahlung erhalten wird, sowie ein re-

lativ kompakter Aufbau der Meßsonde. Allerdings ist die dabei noch zu beachtende Anordnung der Meßsonde gegenüber der Oberfläche des Meßobjektes noch mit einigen Justagemaßnahmen verbunden, die eine Vereinfachung wünschenswert machen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine interferometrische Meßeinrichtung der eingangs angegebenen Art bereitzustellen, die bei verhältnismäßig einfachem, kompaktem Aufbau eine vereinfachte Handhabung ergibt.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Hiernach ist vorgesehen, daß das als Baueinheit aufgebaute Modulationsinterferometer von der Meßsonde räumlich getrennt und über eine Lichtleitfaseranordnung mit dieser koppelbar ist und daß der Meßzweig und der Referenzzweig durch den Meßstrahl und den Referenzstrahl leitende Festkörper gebildet sind.

Die räumlich von dem als Baueinheit aufgebauten Modulationsinterferometer mittels der Lichtleitfaseranordnung getrennte Meßsonde ist ihrerseits durch den Aufbau des Meßzweiges und des Referenzzweiges als Festkörper kompakt und damit gut handhabbar und bezüglich des Meßobjektes einfach justierbar ausgebildet. Auch ist die Justierung des Referenzzweiges und des Meßzweiges der Meßsonde relativ zueinander und bezüglich der interferometrischen Meßeinrichtung wegen der eindeutigen Positionierung der einzelnen Elemente einfach.

Ist der Aufbau derart, daß am Eingang der Meßsonde eine Kollimatoreinrichtung und am Ausgang des Meßzweiges eine Fokussiereinrichtung und ein dieser nachgeschaltetes Ablenkelement zum Auskoppeln und wieder Einkoppeln des zu der zu vermessenden Oberfläche gerichteten und von dieser reflektierten Meßstrahls vorgesehen sind, so werden einerseits zur Bildung des Interferenz-Musters ein günstiger Meßstrahl und Referenzstrahl erhalten, und andererseits wird der Meßstrahl durch das Ablenkelement auch bei einer schräg zur Richtung des Meßzweiges gerichteten zu vermessenden Oberfläche senkrecht zu diesem ausrichtbar, so daß eine zuverlässige Vermessung der Oberfläche erzielt wird. Dabei besteht eine vorteilhafte Ausbildung darin, daß die Kollimatoreinrichtung und/oder die Fokussiereinrichtung eine GRIN-Linse ist/sind.

Mit den Maßnahmen, daß einer der beiden Teilstrahlen in dem Modulationsinterferometer ein Verzögerungselement durchläuft, das eine Differenz der optischen Weglängen der beiden Teilstrahlen erzeugt, die größer ist als die Kohärenzlänge von der kurzkohärenten Strahlungsquelle abgegebene Strahlung, und daß in dem Meßzweig bezüglich des Referenzzweiges eine weitere Differenz der optischen Weglängen erzeugt wird, mit der die durch das Verzögerungselement erzeugte Differenz der optischen Weglängen kompensiert wird, wird ein Interferieren der beiden Teilstrahlen vor dem Eintritt in die Meßsonde vermieden und erst nach der Reflexion an der Oberfläche bzw. in dem Referenzzweig zustandekommt und ein Kohärenzmultiplex ermöglicht wird.

Mehrere Abschnitte der zu vermessenden Oberfläche bzw. mehrere getrennte Oberflächen können ohne Umpositionieren der Meßsonde dadurch schnell und sicher vermessen werden, daß der Meßzweig mindestens ein weiteres Ablenkelement aufweist, mit dem der in dem Meßzweig geführte Meßstrahl aufgespalten und auf eine weitere Stelle der zu vermessenden Oberfläche gerichtet und der von dieser reflektierte Meßstrahl wieder in den Meßzweig eingekoppelt wird. Dabei bestehen zwei verschiedene Aufbaumöglichkeiten darin, daß in dem Modulationsinterferometer mittels austauschbarer, unterschiedlicher Verzögerungselemente unterschiedliche optische Weglängen vorgebar sind, und daß die kompensierende Differenz der optischen Weglängen durch Verstellen eines Reflexions- oder Umlenkele-

menten des Referenzstrahles oder durch den einzelnen abgespalteten Meßstrahl jeweils zugeordnete separate Referenzstrahle in Abstimmung auf die unterschiedlichen Verzögerungselemente gebildet ist. Sind separate Referenzstrahle vorgesehen, so ergibt sich unter Zuordnung zu dem entsprechenden Verzögerungselement ohne weitere Einstellung durch Kohärenzmultiplex die gewählte Meßstelle der Oberfläche eindeutig. Aber auch die Verstellung der kompensierenden optischen Wegdifferenz des Meßstrahles bezüglich des Referenzstrahles mittels des Reflexions- bzw. Umlenkelementes des Referenzstrahles ist relativ einfach möglich.

Zwei unterschiedliche Aufbaumöglichkeiten für die Meßsonde bestehen darin, daß der Meßstrahl und der oder die Referenzstrahl(e) als getrennte Arme der Meßsonde nach Art eines Michelson-Interferometers (wie in Fig. 1 und 2 dargestellt) oder in einem gemeinsamen Arm nach Art eines Fizeau-Interferometers aufgebaut ist (wie in Fig. 3 dargestellt). Sind dabei der Meßstrahl und der Referenzstrahl in einem gemeinsamen Arm der Meßsonde ausgebildet, so ergibt sich eine besonders kompakte Bauweise der Meßsonde, die auch unter ungünstigen Platzverhältnissen eingesetzt werden kann.

Eine weitere Vereinfachung des Aufbaus der Meßeinrichtung wird dadurch erzielt, daß der zur Meßsonde hin und von dieser zurückgeleitete Strahl über eine gemeinsame monomode Lichtleitfaseranordnung geführt ist und daß der zur Empfängereinheit geführte Strahl aus der Lichtleitfaseranordnung mittels eines Abzweigstückes ausgekoppelt ist. Die Ankopplung der Meßsonde an das Modulationsinterferometer und die Empfängereinheit kann dabei auf einfache Weise mittels Steckverbindern erfolgen.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer interferometrischen Meßeinrichtung mit einer von einem Modulationsinterferometer räumlich getrennten Meßsonde,

Fig. 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel der interferometrischen Meßeinrichtung mit mehreren Meßstrahlen und Referenzstrahlen und

Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel der interferometrischen Meßeinrichtung, bei der der Meßstrahl und der Referenzstrahl anders ausgebildet sind.

Die in den Fig. 1 bis 3 gezeigten Ausführungsbeispiele einer interferometrischen Meßeinrichtung zum Erfassen der Form, der Rauheit oder des Abstandes von Oberflächen bestehen jeweils aus einem Modulationsinterferometer 1 und einer davon räumlich getrennten, über eine Lichtleitfaseranordnung 4 angekoppelten Meßsonde 2, sowie einer den daraus zurückgeführten Strahl aufnehmenden Empfängereinheit 3.

Das Modulationsinterferometer 1 weist eine Strahlungsquelle 11 vorzugsweise in Form einer kurzkohärenten breitbandigen Strahlungsquelle 11 mit einer kontinuierlichen Strahlungsverteilung einer Vielzahl unterschiedlicher Wellenlängen bei gleichzeitig guter räumlicher Kohärenz auf, wie z. B. eine Superlumineszenzdiode. Die Strahlung der Strahlungsquelle 11 wird mittels einer Kollimatorlinse 12 kollimiert und mittels eines ersten Strahlteilers 13 in zwei Teilstrahlen aufgeteilt, die jeweils durch akustooptische Modulatoren 14, 14' geführt und über Ablenkspiegel 15, 15' an einem zweiten Strahlteiler 13' wieder zusammengeführt werden, wobei einer der beiden Teilstrahlen über ein Verzögerungselement 16 bzw. 16' (vgl. Fig. 2 und 3) geführt wird. Die vereinigten Teilstrahlen gelangen über ein Objektiv 17 in die monomode Lichtleitfaseranordnung 4.

Die beiden Teilstrahlen werden mittels der akustoopti-

schen Modulatoren 14 bzw. 14' mit benachbarten, aber unterschiedlichen Frequenzen moduliert. Mittels des Verzögerungselementes 16 bzw. 16' wird eine optische Wegdifferenz der beiden Teilstrahlen in dem Modulationsinterferometer, beispielsweise des Mach-Zehnder-Typs, erzeugt, wobei das Verzögerungselement 16, 16' beispielsweise als Glasplatte einer bestimmten Dicke ausgebildet ist. Auf diese Weise sind die durch den z. B. als halbdurchlässige Scheibe ausgebildeten Strahlteiler 13' vereinigten Teilstrahlen als getrennte Wellenzüge mit zwei benachbarten, verschiedenen Frequenzen vorhanden und räumlich gegeneinander mit einer Länge verschoben, die oberhalb der Kohärenzlänge der Strahlungsquelle 11 liegt.

Die Meßsonde 2 gemäß den Fig. 1 und 2 ist als Interferometer des Michelson-Typs aufgebaut. Der über die monomode Lichtleitfaseranordnung 4 zugeführte vereinigte Lichtstrahl wird mittels einer Kollimatoreinrichtung 21 in Form eines Objektivs kollimiert, anschließend mittels eines dritten Strahlteilers 22 in einen Meßstrahl und einen Referenzstrahl aufgeteilt. Der Meßstrahl wird am ausgangsseitigen Ende eines den Meßstrahl führenden Meßzweiges 211 mittels einer Fokussiereinrichtung 23 in Form eines Objektivs fokussiert und am Ausgang des Meßzweiges 211 mittels eines Ablenkelementes 24 in Form eines Prismas in der Weise abgelenkt, daß die Achse des Strahlkegels am Ausgang des Prismas senkrecht auf die zu messende Oberfläche gerichtet wird. Die Einheit aus dem Prisma 24 und dem Objektiv 23 kann ausgetauscht werden, so daß Oberflächen anderer Kontur vermessen werden können. Die Kollimatoreinrichtung 21 am Eingang der Meßsonde 2 sowie die Fokussiereinrichtung 23 im Endbereich des Meßzweiges 211 sind vorzugsweise als GRIN (= grade-index)-Linse ausgebildet, die eine günstige Strahlführung bietet.

Der an dem dritten Strahlteiler abgetrennte Referenzstrahl wird in einem Referenzstrahl 212 auf ein an dessen Ende vorgesehenes Reflektorelement 28 in Form eines Prismas geführt und dort umgelenkt, wobei das Prisma in Richtung der optischen Achse des Referenzstrahles 212 verstellt werden kann. Der Meßstrahl 211, der den Meßstrahl als kollimierten Strahl 25 führt, weist an den dritten Strahlteiler 22 anschließend einen Meßstrahl-Leitkörper 26 in Form eines Festkörpers auf, während der Referenzstrahl 212 einen Referenzstrahl-Leitkörper 27 bzw. 27' in Form eines weiteren Festkörpers aufweist.

Die Länge des kollimierten Strahles 25 in dem Meßstrahl 211 und sein Durchmesser sind an die Abmessungen des Meßobjektes, beispielsweise der Tiefe und den Durchmesser einer zu vermessenden Bohrung angepaßt. Der Abschnitt, in dem der Strahl 25 kollimiert ist, kann als Glaszylinder ausgebildet sein, so daß die Meßsonde 2 kompakt ausgebildet ist.

Der Referenzstrahl durchläuft ein Medium 27 großer Dispersion, wie z. B. ein Glasstück, um die chromatische Dispersion des Meßzweiges 211 und des Verzögerungselementes 16 des Modulationsinterferometers 1 zu kompensieren. Der Referenzstrahl wird mittels des Reflektors 28, etwa einen Spiegel oder ein katadioptrisches Element zurückgeführt, wobei durch Verstellen des Reflektors 28 eine kompensierende optische Wegdifferenz zwischen dem Meßstrahl 211 und dem Referenzstrahl 212 justierbar ist, die die durch das Verzögerungselement 16 erzeugte optische Wegdifferenz ausgleicht.

Der über den Meßstrahl 211 zurückgeführte Meßstrahl und der über den Referenzstrahl 212 zurückgeführte Referenzstrahl interferieren an dem dritten Strahlteiler 22 und werden über die Lichtleitfaseranordnung 4, die auch zur Zuleitung des vereinten Strahls zu der Meßsonde 2 dient, zurückgeführt und über ein Abzweigstück 41 zur Empfängerein-

einheit 3 geleitet. Die Lichtleitfaseranordnung 4 kann dabei mittels Steckverbinder 42, 42' mit der Meßsonde 2 einerseits und dem Modulationsinterferometer 1 sowie der Empfänger-
einheit 3 andererseits gekoppelt werden. Die Steckver-
binder des Modulationsinterferometers 1, der Meßsonde 2
und/oder der Empfänger-
einheit 3 können dabei als entspre-
chende Buchse unmittelbar an dem Gehäuse angeordnet
sein.

Das Aufnahmeobjektiv 31 der Empfänger-
einheit 3 bewirkt, daß die Austrittsfläche der monomodalen Lichtleitfaseranordnung 4 nach Durchlaufen einer Strahlzerlegungs-
einheit 32 in die Ebene einer Fotoempfangereinheit 33 abge-
bildet wird. Jede Fotodiode empfängt also die Abbildung
der Austrittsfläche der Lichtleitfaseranordnung mit einer ge-
gebenen Wellenlänge.

Wie Fig. 2 zeigt, ist in dem Meßzweig 211 ein weiterer
Strahlteiler 29 in Form eines Prismas angeordnet, mit dem
ein weiterer Meßstrahl abgezweigt wird. Dieser besitzt ge-
genüber dem ersten, durchgehenden Meßstrahl einen unter-
schiedlichen Auskoppelwinkel, so daß Oberflächenbereiche
unterschiedlicher Ausrichtung gleichzeitig vermessen werden
können, wobei die Position der Meßsonde bezüglich des
Meßobjektes beibehalten wird und keine zusätzlichen Justa-
gearbeiten erforderlich sind. Bezüglich des weiteren Meß-
strahls ergibt sich eine weitere optische Wegdifferenz zwi-
schen dem Meßzweig 211 und dem Referenzzweig 212, die
mittels eines Austausches des Verzögerungselementes 16
durch ein anderes Verzögerungselement 16' einer entspre-
chend angepaßten optischen Wegdifferenz ausgeglichen
werden kann. Eine genaue Einstellung der kompensierenden
optischen Wegdifferenz in der Meßsonde 2 kann dabei bei-
spielsweise durch Verstellen des Reflektors 28 vorgenom-
men werden, so daß der abgespaltete Meßstrahl mit dem Re-
ferenzstrahl zur Interferenz gebracht wird. Die Meßstelle
kann dabei durch das eingesetzte Verzögerungselement 16
bzw. 16' und den Kohärenzmultiplex identifiziert werden.
Gemäß Fig. 2 ist aber zur Erzeugung einer auf das ausgetauschte Verzögerungselement 16' abgestimmten kompen-
sierenden optischen Wegdifferenz ein zweiter Referenz-
zweig mit einem zweiten Referenzstrahl-Leitkörper 27' und
einem zweiten Reflektor 28' gebildet, so daß sich zwei fest
vorgegebene kompensierende optische Wegdifferenzen ent-
sprechend den zwei Meßstrahlen bzw. Meßstellen abge-
stimmt auf die optischen Wegdifferenzen der Verzögerungs-
elemente 16 bzw. 16' ergeben, wobei die kompensierenden
Wegdifferenzen allenfalls noch durch eine Feinjustierung
des Reflektors 28 bzw. 28' eingestellt zu werden brauchen.
Zur Bildung der beiden Referenzzweige sind zwei dritte
Strahlteiler 22 bzw. 22' vorgesehen.

Entsprechend können auch mehr Meßstrahlen durch wei-
tere Strahlteiler 29 gebildet werden, wobei immer ein Teil
des Meßstrahles durch den Strahlteiler 29 zu dem dahinter
angeordneten Strahlteiler bzw. Ausgang des Meßzweiges
211 ohne Ablenkung durchgelassen wird. Die Anzahl der
Referenzzweige entspricht dann vorzugsweise der Anzahl
der gebildeten Meßstrahlen, und es sind auch entsprechend
viele Verzögerungselemente in dem Modulationsinterfero-
meter 1 vorhanden, so daß mittels Kohärenzmultiplex eine
eindeutige Zuordnung zur Meßstelle gegeben ist.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel der interferometrischen
Meßeinrichtung ist in Fig. 3 gezeigt. Die Arbeitsweise ent-
spricht dabei derjenigen gemäß Fig. 2. Im Unterschied zu
dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 ist die Meßsonde 2
als Interferometer des Fizeau-Typs ausgebildet, bei dem am
Eingang der Meßsonde 2 beispielsweise nach einem Licht-
leiter 26 in Form eines Glaszylinders wiederum eine GRIN-
Linse 21 und entsprechend auch im Endbereich des Meß-
zweiges GRIN-Linsen 21, 23, 21' und 23' angeordnet sind.

Vor der Abkoppelstelle des ersten Meßstrahles ist im Be-
reich der Eingangs-GRIN-Linse ein teildurchlässiges opti-
sches Element angeordnet, an dem ein Teil des in die Meß-
sonde 2 geführten Strahls reflektiert wird. In diesem teil-
durchlässigen Element erfolgt eine Interferenz mit dem an
der im Strahlengang ersten Stelle abgezweigten und von der
zu vermessenden Oberfläche zurücklaufenden Meßstrahl,
wobei die optische Wegdifferenz zwischen dem Meßstrahl
und dem an dem teildurchlässigen optischen Element gebil-
deten Referenzstrahl so groß ist, daß die Wegdifferenz des in
dem Modulationsinterferometer 1 vorgesehenen Verzöge-
rungselements 16 kompensiert wird. Entsprechend ist auch
in dem im Strahlengang hinter der Abzweigstelle des ersten
Meßstrahles angeordneten GRIN-Linse ein teildurchlässi-
ges optisches Element 28.1' angeordnet, an dem eine Inter-
ferenz in der vorstehend beschriebenen Weise mit dem über
den Endbereich der Meßsonde 2 geführten Meßstrahl er-
zeugt wird. Die zwischen diesem weiteren teildurchlässigen
optischen Element 28.1' und dem zugehörigen Meßstrahl ge-
bildete kompensierende optische Wegdifferenz ist auf ein
weiteres in dem Modulationsinterferometer 1 angeordnetes
Verzögerungselement 16' abgestimmt. Auch bei diesem
Aufbau der interferometrischen Meßeinrichtung können da-
her die Meßstellen aufgrund des eingesetzten optischen Ver-
zögerungselementes 16 bzw. 16' in Folge Kohärenzmultiplex
identifiziert werden.

Die teildurchlässigen optischen Elemente 28.1, 28.1' sind
eben und senkrecht zur optischen Achse des Meßstrahls aus-
gebildet und sie können in einem Fokussierungspunkt 28 des op-
tischen Strahls oder in einer Ebene angeordnet sein, in der
der durch den Meßzweig 211 verlaufende Strahl kollimiert
ist. Es kann ein einziger Referenzstrahl für alle Meßstrahlen
(bzw. Auskoppelprismen der Meßstrahlen), also eine ein-
zige reflektierende Fläche vorgesehen sein oder es können
ebenso viele Referenzstrahlen wie Meßstrahlen bzw. Aus-
koppelprismen, also entsprechend viele reflektierende Flä-
chen vorgesehen sein. Die Justierung des optischen Weges
des Referenzstrahles läßt sich dadurch erzielen, daß die
Dicke des Verzögerungselementes 16, 16' in dem Modu-
lationsinterferometer 1 geändert wird. Die Änderung der Dicke
kann z. B. durch Drehen der Glasplatte des Verzögerungs-
elementes 16, 16' oder durch Austausch von zwei scheiben-
förmigen Glasplatten geschehen. Die Kompensation der
chromatischen Dispersion kann dadurch erfolgen, daß in
dem anderen Zweig des Modulationsinterferometers 1 eine
Scheibe 18, 18' eines sehr dispersiven Materials, wie z. B.
einer Glasplatte und gegebener Dicke eingesetzt wird. Um
eine gegebene Oberfläche zu vermessen, genügt es, ein an
das Profil der zu messenden Oberfläche angepaßtes Prisma
zu verwenden und in dem Modulationsinterferometer 1 eine
entsprechende Glasplatte als Verzögerungselement 18, 18'
bzw. zur Kompensation der chromatischen Dispersion zu
verwenden.

Die optische Strahlungsleistung des Meßstrahles in dem
Meßzweig 211 ist in der Regel sehr viel geringer als die op-
tische Strahlungsleistung des Referenzstrahles in dem Refe-
renzzweig 212. Daher ist es vorteilhaft, den dritten Strahltei-
ler 22 bzw. 22' unsymmetrisch auszubilden, um eine vergrößerte
Strahlungsleistung des zurückgeführten Meßstrahls zu
erhalten, die derjenigen des Referenzstrahles vergleichbar
ist.

Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 ist von Vor-
teil, daß außer der schlanken Form durch den in einem ge-
meinsamen Arm verlaufenden Meßzweig und Referenz-
zweig die Meßsonde 2 weniger empfindlich gegen Tempera-
turänderungen ist.

Ein Vorteil aller Ausführungsformen ist, daß die Einstell-
und Regulierungseinrichtung der Meßsonde 2 in dem Mo-

dulationsinterferometer 1 von dieser getrennt ist. Dieselbe Einstell- und Regulierungsvorrichtung kann für eine große Anzahl von Meßsonden 2 verwendet werden, wodurch die Meßvorrichtung kostengünstig wird.

Patentansprüche

1. Interferometrische Meßeinrichtung zum Erfassen der Form, der Rauheit oder des Abstandes von Oberflächen

- mit einem Modulationsinterferometer (1), das eine räumlich kohärente Strahlungsquelle (11) und einen ersten Strahlteiler (13) zum Aufteilen von deren Strahlung in zwei Teilstrahlen aufweist, von denen der eine gegenüber dem anderen mittels einer Modulationseinrichtung (14, 14') in seiner Licht-Phase oder Licht-Frequenz verschoben ist und die anschließend vereinigt sind,
- mit einer Meßsonde (2), in der die vereinigten Teilstrahlen in einen durch einen Meßzweig (211) geführten und an der Oberfläche reflektierten Meßstrahl sowie einen durch einen Referenzzweig (212) geführten und darin reflektierten Referenzstrahl aufgeteilt werden und in der der reflektierte Meßstrahl mit dem reflektierten Referenzstrahl überlagert wird, und
- mit einer Empfängereinheit (3) zum Aufspalten der überlagerten Strahlung in mindestens zwei Strahlen mit unterschiedlichen Wellenlängen und Umwandeln der Strahlung in elektrische Signale und zum Auswerten der Signale auf der Grundlage einer Phasendifferenz,

dadurch gekennzeichnet,

daß das als Baueinheit aufgebaute Modulationsinterferometer (1) von der Meßsonde (2) räumlich getrennt und über eine Lichtleitfaseranordnung (4) mit dieser koppelbar ist und

daß der Meßzweig (211) und der Referenzzweig (212) durch den Meßstrahl und den Referenzstrahl leitende Festkörper gebildet sind.

2. Meßeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß am Eingang der Meßsonde (2) eine Kollimatoreinrichtung (21) und am Ausgang des Meßzweigs (29) eine Fokussiereinrichtung (23) und ein dieser nachgeschaltetes Ablenkelement (24) zum Auskoppeln und wieder Einkoppeln des zu der zu vermessenden Oberfläche gerichteten und von dieser reflektierten Meßstrahls vorgesehen sind.

3. Meßeinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Kollimatoreinrichtung (21) und/oder die Fokussiereinrichtung (23) eine GRIN-Linse ist/sind.

4. Meßeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß einer der beiden Teilstrahlen in dem Modulationsinterferometer (1) ein Verzögerungselement (16, 16') durchläuft, das eine Differenz der optischen Weglängen der beiden Teilstrahlen erzeugt, die größer ist als die Kohärenzlänge der von der kurzkohärenten Strahlungsquelle (11) abgegebene Strahlung, und daß in dem Meßzweig (211) bezüglich des Referenzzweiges (212) eine weitere Differenz der optischen Weglängen erzeugt wird, mit der die durch das Verzögerungselement (16, 16') erzeugte Differenz der optischen Weglängen kompensiert wird.

5. Meßeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Meßzweig (211) mindestens ein weiteres Ablenkelement

(29) aufweist, mit dem der in dem Meßzweig (211) geführte Meßstrahl aufgespalten und auf eine weitere Stelle der zu vermessenden Oberfläche gerichtet und der von dieser reflektierte Meßstrahl wieder in den Meßzweig (211) eingekoppelt wird.

6. Meßeinrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,

daß in dem Modulationsinterferometer (1) mittels austauschbarer unterschiedlicher Verzögerungselemente (16, 16') unterschiedliche optische Weglängen vorgebar sind, und

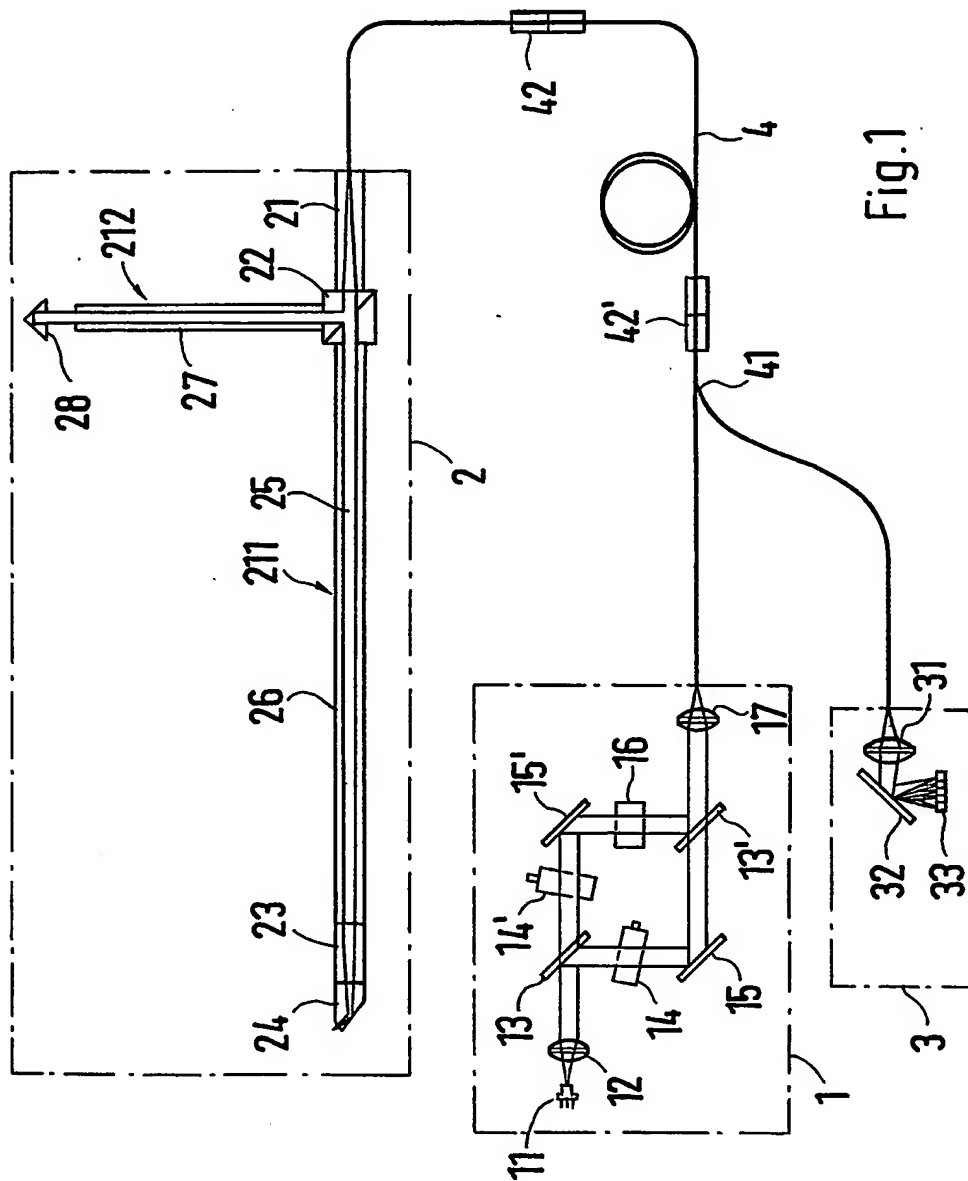
daß die kompensierende Differenz der optischen Weglängen durch Verstellen eines Reflexions- oder Umlenkelementes (28, 28') des Referenzzweiges (212) oder durch den einzelnen abgespaltenen Meßstrahlen jeweils zugeordnete separate Referenzzweige in Abstimmung auf die unterschiedlichen Verzögerungselemente (16, 16') gebildet ist.

7. Meßeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Meßzweig (211) und der oder die Referenzzweig(e) (212) als getrennte Arme der Meßsonde (2) nach Art eines Michelson-Interferometers (Fig. 1 und 2) aufgebaut ist.

8. Meßeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Meßzweig (211) und der oder die Referenzzweig(e) (212) in einem gemeinsamen Arm nach Art eines Fizeau-Interferometers (Fig. 3) aufgebaut ist.

9. Meßeinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der zur Meßsonde (2) hin und von dieser zurückgeleitete Strahl über eine gemeinsame monomode Lichtleitfaseranordnung (4) geführt ist und daß der zur Empfängereinheit (3) geführte Strahl aus der Lichtleitfaseranordnung (4) mittels eines Abzweigstückes (41) ausgekoppelt ist.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen



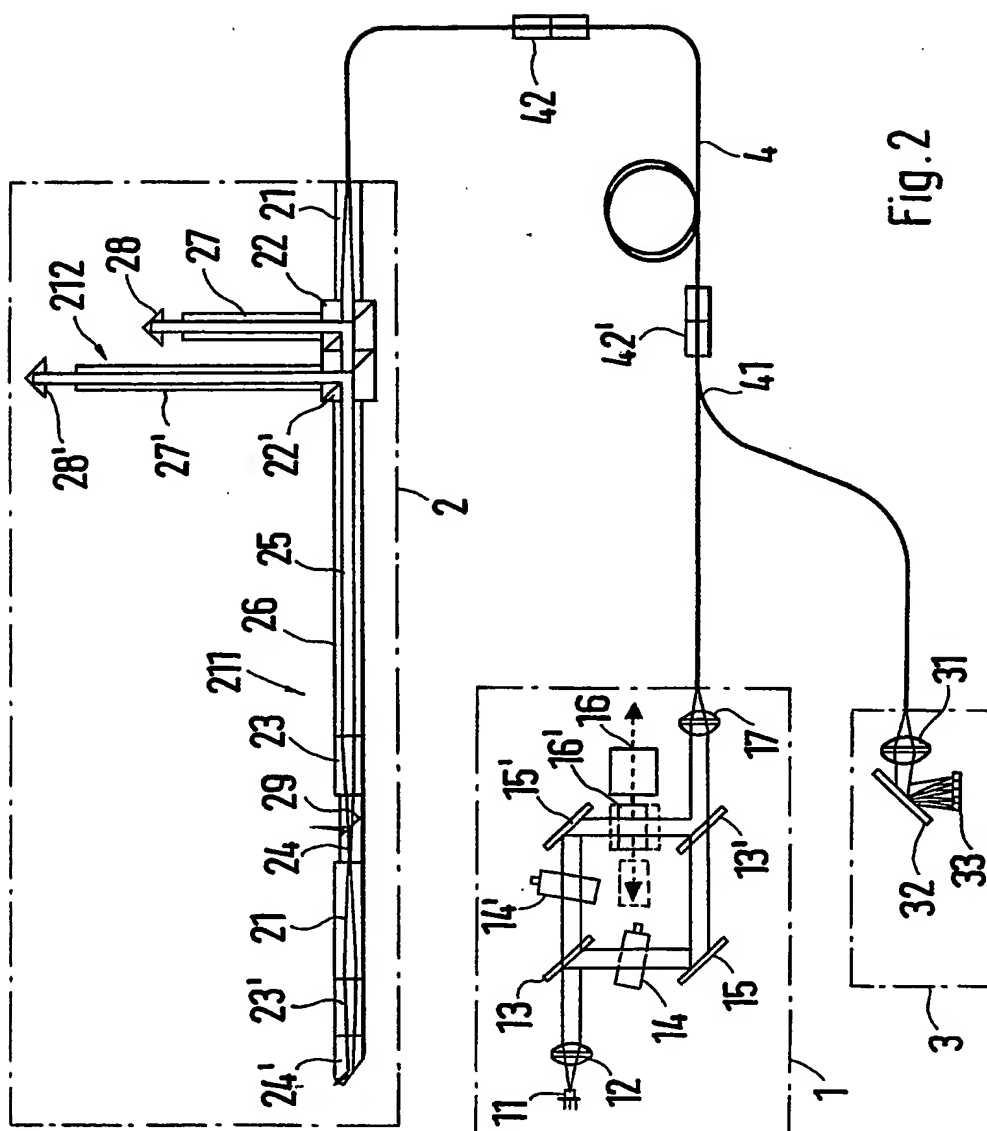


Fig. 2

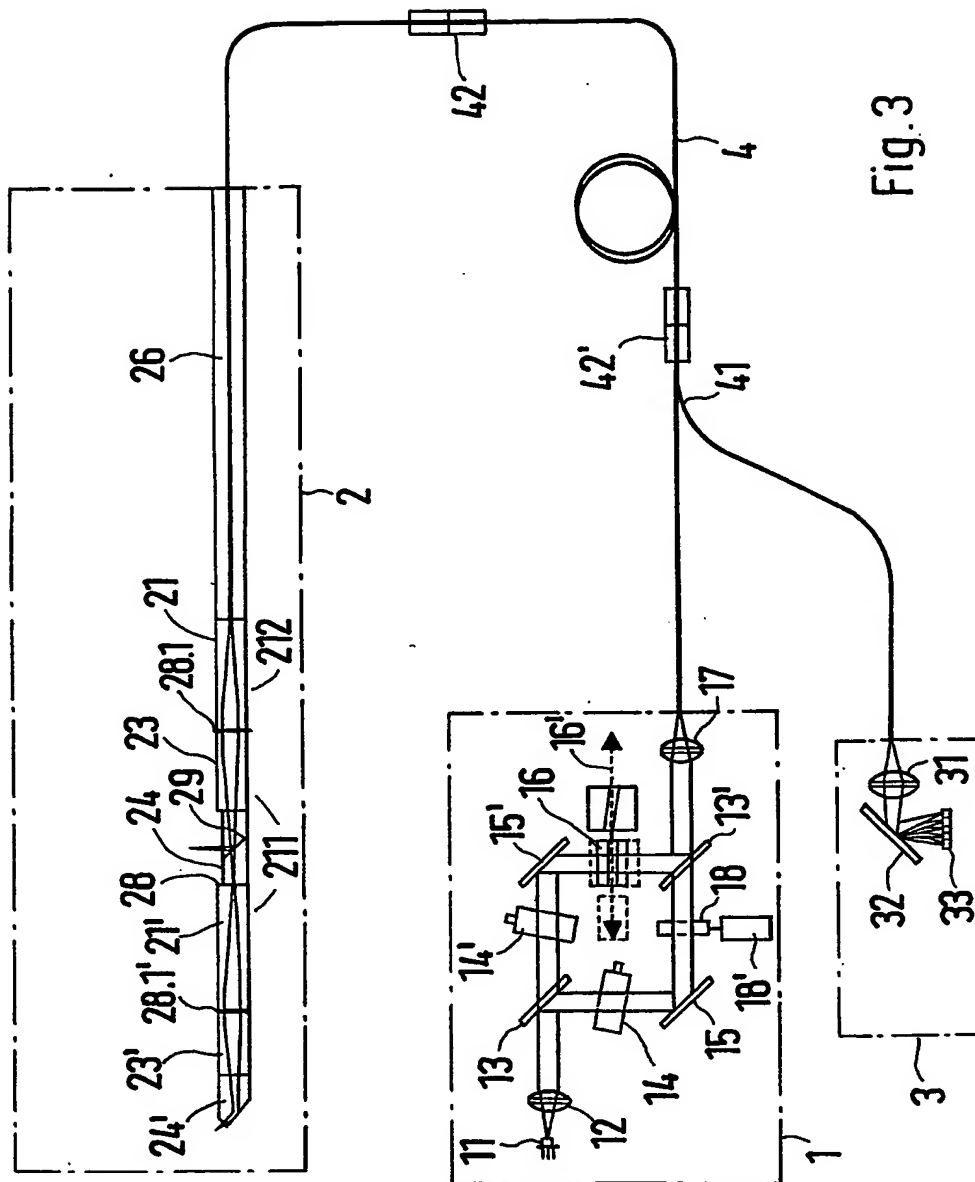


Fig. 3

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.